

装置の概要

【型式等】

- 装置名称：走査型プローブ顕微鏡
- メーカー：パーク・システムズ・ジャパン社
+ハイジトロン社
- 型式：XE7+TriboScope-1D

【仕様】

- 走査範囲：X 100 μm×Y 100 μm×Z 12 μm
- 最大試料サイズ：100 mm×100 mm×20 mm厚
- オプションモード：ナノインデンテーション、EFM、SKPM、C-AFM、MFM



ナノスケールでの表面形状・物性の同時評価が可能です！

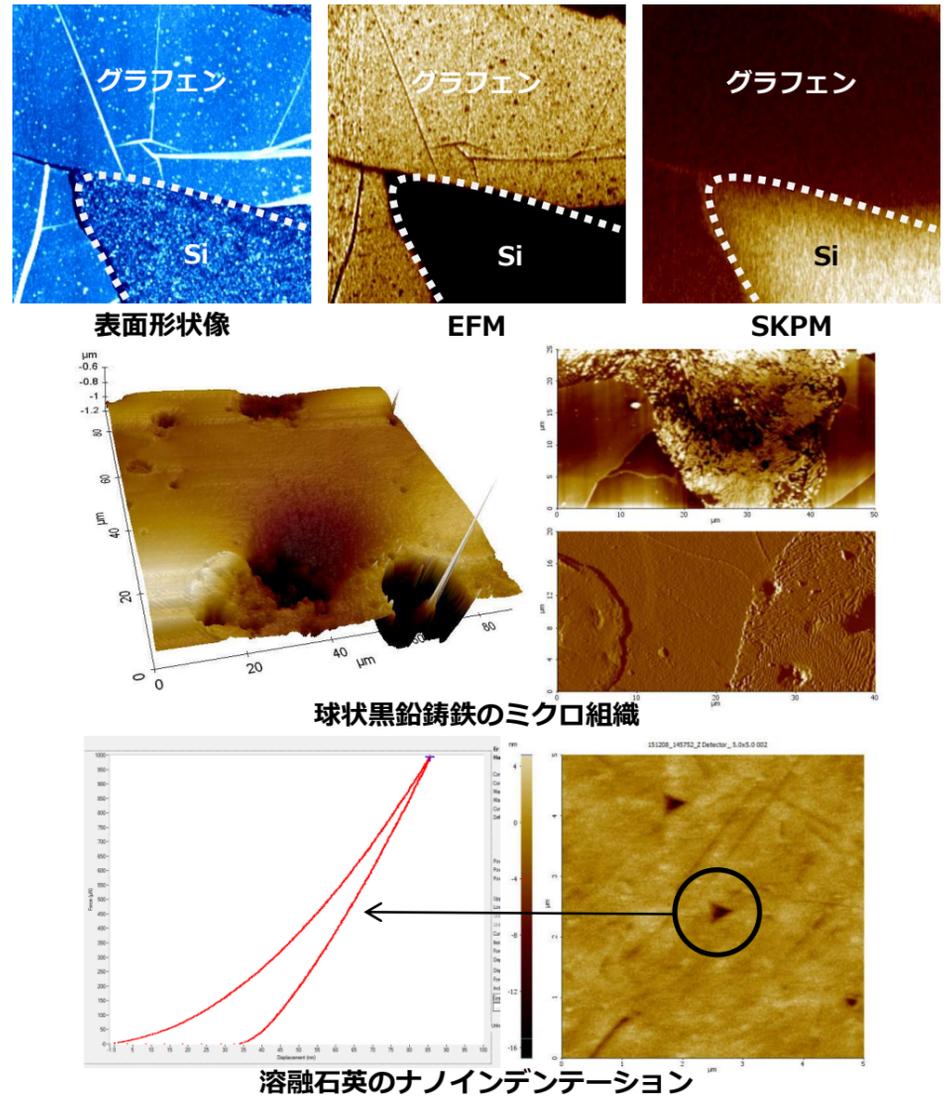
【装置の特徴】

本装置は、ナノスケールでの表面形状測定と同時に電気的特性・磁気的特性・粘弾性特性などの表面物性評価も可能です。さらにナノインデンテーション機能を付与したことにより力学特性の評価が可能です。

イメージングは、一般的なタッピング（間欠的接触）モードではなく、ノンコンタクト（非接触）モードを標準としているため、製品や探針へのダメージが少なく、信頼性の高いイメージを取ることができます。また、XYステージとZスキャナが分離したスキャン機構を採用しているため、高精度な形状評価が可能です。

【主な用途】

- 研磨面の表面平滑性の評価
- ナノオーダーのコーティング膜の硬度測定
- 表面処理による表面物性変化の評価
- エッチング残渣と電気的特性の評価
- etc...



料金・問い合わせ先

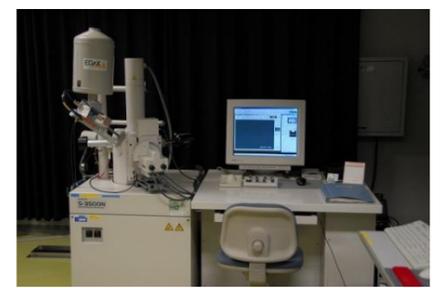
区分	単位	料金(円)
設備使用 ナノスケール物性測定システム (走査型プローブ顕微鏡 XE7+TS1D)	1時間ごと	7,030
依頼試験	—	—

〒963-0297
郡山市待池台1丁目12番地
TEL：024-959-1737（工業材料科）
FAX：024-959-1761

併せて使うと効果的です！



エックス線光電子分光装置
(14,580円/時間)



低真空走査型電子顕微鏡
(9,440円/時間)